

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

US 5,736,761



(11)

EP 0 744 772 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
27.11.1996 Patentblatt 1996/48

(51) Int. Cl.⁶: H01L 27/108, H01L 21/8242

(21) Anmeldenummer: 96107434.1

(22) Anmeldetag: 10.05.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT DE FR GB IE IT NL

(30) Priorität: 24.05.1995 DE 19519159

(71) Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
80333 München (DE)

(72) Erfinder:

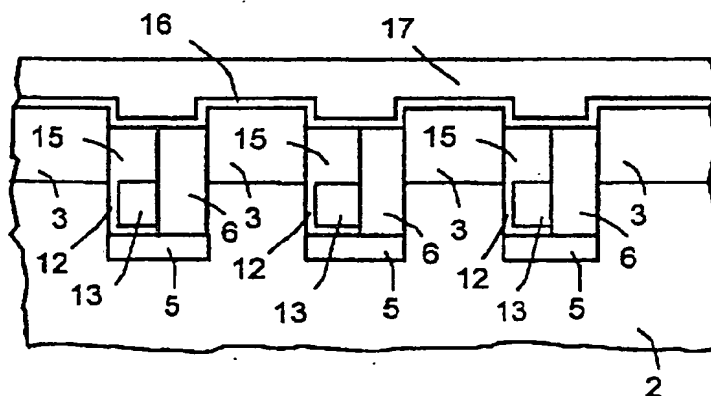
- Rösner, Wolfgang, Dr.
81739 München (DE)
- Risch, Lothar, Dr.
85579 Neubiberg (DE)
- Hofmann, Franz, Dr.
80995 München (DE)
- Krautschneider, Wolfgang, Dr.
83104 Hohenthann (DE)

(54) **DRAM-Speicherzelle mit vertikalem Transistor und Verfahren zur Herstellung derselben**

(57) Die DRAM-Zellenanordnung umfaßt pro Speicherzelle einen vertikalen MOS-Transistor, dessen erstes Source/Drain-Gebiet an eine vergrabene Bitleitung (5) angrenzt, dessen Gateelektrode (13) mit einer vergrabenen Wortleitung verbunden und dessen zweites Source/Drain-Gebiet (3) an eine Substrathauptfläche (1) angrenzt, auf der ein Kondensatordielektrikum

(16), das insbesondere eine ferroelektrische oder paraelektrische Schicht ist, und eine Kondensatorplatte (17) angeordnet sind, so daß das zweite Source/Drain-Gebiet (3) zusätzlich als Speicherknoten wirkt. Die DRAM-Zellenanordnung ist mit einer Speicherzellenfläche von $4 F^2$ herstellbar.

FIG 5



EP 0 744 772 A1

Beschreibung

In DRAM-Zellenanordnungen, das heißt, Speicherzellenanordnungen mit dynamischen, wahlfreiem Zugriff, werden fast ausschließlich sogenannte Eintransistor-Speicherzellen eingesetzt. Eine Eintransistor-Speicherzelle umfaßt einen Auslesetransistor und einen Speicherkondensator. In dem Speicherkondensator ist die Information in Form einer elektrischen Ladung gespeichert, die eine logische Größe, Null oder Eins, darstellt. Durch Ansteuerung des Auslesetransistors über eine Wortleitung kann diese Information über eine Bitleitung ausgelesen werden.

Da von Speichergeneration zu Speichergeneration die Speicherdichte zunimmt, muß die benötigte Fläche der Eintransistorspeicherzelle von Generation zu Generation reduziert werden. Da der Reduktion der Strukturgrößen durch die minimale in der jeweiligen Technologie herstellbare Strukturgröße F Grenzen gesetzt sind, ist dies auch mit einer Veränderung der Eintransistorspeicherzelle verbunden. So wurden bis zur 1MBit-Generation sowohl der Auslesetransistor als auch der Speicherkondensator als planare Bauelemente realisiert. Ab der 4MBit-Speichergeneration mußte eine weitere Flächenreduzierung durch eine dreidimensionale Anordnung von Auslesetransistor und Speicherkondensator erfolgen. Eine Möglichkeit besteht darin, den Speicherkondensator in einem Graben zu realisieren (siehe zum Beispiel Yamada, K. et al, A deep trench capacitor technology for 4Mbit DRAMs Proc. Intern. Electronic Devices & Materials IEDM 85, p. 702).

Ferner ist vorgeschlagen worden (siehe zum Beispiel Kawamoto, Y. et al, A 1,28 μm^2 Shielded Memory Cell Technology for 64Mbit DRAMs, Techn. Digest of VLSI Symposium, 1990, p. 13), den Speicherkondensator als Stapelkondensator, den sogenannten stacked capacitor, auszuführen. Dabei wird über den Wortleitungen eine Struktur aus Polysilizium, zum Beispiel eine Kronenstruktur oder ein Zylinder gebildet, der mit dem Substrat kontaktiert wird. Diese Polysiliziumstruktur bildet den Speicherknoten. Er wird mit Kondensatordielektrikum und Kondensatorplatte versehen. Dieses Konzept hat den Vorzug, daß es weitgehend mit einem Logikprozeß kompatibel ist.

Die Fläche für eine Speicherzelle eines DRAM in der 1GBit-Generation soll nur etwa 0,2 μm^2 betragen. Der Speicherkondensator muß dabei eine Kapazität von 20 bis 30 fF aufweisen. Eine derartige Kapazität ist bei einer Zellfläche, wie sie bei der 1GBit-Generation zur Verfügung steht, in einem Stapelkondensator nur mit einer relativ komplizierten Struktur der Polysiliziumstruktur machbar. Diese komplizierten Strukturen sind zusätzlich durch ihre Topologie immer schwieriger herstellbar.

Ferner ist vorgeschlagen worden, die pro Fläche erzielbare Kapazität durch Verwendung eines Dielektrikum mit einer hohen Dielektrizitätskonstante zu erhöhen. Als Dielektrikum mit hoher Dielektrizitätskonstante

sind insbesondere Para- und Ferroelektrika geeignet (siehe zum Beispiel WO 93/12542).

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine DRAM-Zellenanordnung anzugeben, die als Speicherzellen Eintransistorspeicherzellen umfaßt und die in der für die 1GBit-Generation erforderlichen Packungsdichte herstellbar ist. Ferner soll ein Herstellverfahren für eine solche DRAM-Zellenanordnung angegeben werden.

Dieses Problem wird gelöst durch eine DRAM-Zellenanordnung gemäß Anspruch 1 sowie ein Verfahren zu deren Herstellung gemäß Anspruch 8. Weitere Ausgestaltungen der Erfindung gehen aus den übrigen Ansprüchen hervor.

In der erfindungsgemäßen DRAM-Zellenanordnung sind Eintransistorspeicherzellen vorgesehen, in denen der Auslesetransistor als vertikaler MOS-Transistor ausgebildet ist. Dabei grenzt eines der Source/Drain-Gebiete des vertikalen MOS-Transistors an eine Hauptfläche eines Halbleitersubstrats, in dem die DRAM-Zellenanordnung realisiert ist, an. Das andere Source/Drain-Gebiet grenzt an eine vergrabene Bitleitung an. Auf der Hauptfläche ist an der Oberfläche des dort angrenzenden Source/Drain-Gebietes ein Kondensatordielektrikum und darüber eine Zellplatte angeordnet. Das an die Hauptfläche angrenzende Source/Drain-Gebiet wird zusätzlich als Speicherknoten für den aus Kondensatorplatte, Kondensatordielektrikum und Source/Drain-Gebiet gebildeten Speicherkondensator.

Das Kanalgebiet des MOS-Transistors ist im Halbleitersubstrat angeordnet und mit einem Gatedielektrikum und einer Gateelektrode versehen. Die Gateelektrode ist mit einer Wortleitung verbunden. Gateelektroden und Wortleitungen sind im Substrat vergraben und durch Isolationsstrukturen gegenüber den Source/Drain-Gebieten, den Bitleitungen und den Kanalgebieten isoliert.

Die DRAM-Zellenanordnung wird vorzugsweise in einem Halbleitersubstrat realisiert, das mindestens in dem Bereich für die DRAM-Zellenanordnung monokristallines Silizium umfaßt. Das kann sowohl eine Scheibe durchgehend aus monokristallinem Silizium als auch ein SOI-Substrat, das auf eine Siliziumscheibe eine isolierende Schicht und darauf eine dünne monokristalline Siliziumschicht umfaßt, sein.

Vorzugsweise wird das Kondensatordielektrikum aus einem Material mit einer relativen Dielektrizitätskonstante ϵ_r zwischen 100 und 1000 gebildet.

Die erfindungsgemäße DRAM-Zellenanordnung kann mit einer planaren Oberfläche oder mit einer Oberfläche mit einer flachen Topologie hergestellt werden, so daß als Kondensatordielektrikum eine ferroelektrische oder paraelektrische Schicht verwendet werden kann. Ferroelektrische und paraelektrische Schichten weisen eine hohe relative Dielektrizitätskonstante ϵ_r im Bereich von 500 bis 1000 auf. Wenn diese Schichten durch Sputtern abgeschieden werden, sind sie nur auf ebenen Oberflächen oder Oberflächen mit einer flachen Topologie einsetzbar. Auch bei CVD- oder Sol-Gel-Ver-

fahren mit besserer Kantenbedeckung können durch die benötigte Dicke der Schichten keine komplizierten 3D-Strukturen hergestellt werden. Als Kondensatordielektrikum wird vorzugsweise Barium-Strontium-Titanat, Blei-Zirkon-Titanat, oder Strontium-Titanat verwendet. Ferner sind die aus WO 93/12542 bekannten Materialien als Kondensatordielektrikum geeignet. Mit diesen Dielektrika mit hoher relativer Dielektrizitätskonstante kann die erforderliche Kapazität in 20 bis 30 fF auch auf einer Fläche von etwa 0,2 bis 0,4 μm^2 erzielt werden.

Vorzugsweise weist das Halbleitersubstrat in Reihen und Spalten angeordnete Säulen aus Halbleitermaterial auf. Die vertikalen MOS-Transistoren werden dann entlang mindestens einer Flanke dieser Säulen so realisiert, daß Gatedielektrikum und Gateelektrode die Flanke der jeweiligen Säule parallel zur Hauptfläche des Halbleitersubstrats nur teilweise bedecken. Besonders vorteilhaft herstellbar sind die vertikalen MOS-Transistoren, wenn sie zwei aneinandergrenzende Flanken der Säulen jeweils teilweise bedecken.

Gemäß einer Ausführungsform verlaufen die Bitleitungen jeweils zwischen benachbarten Reihen von Säulen. Zwischen benachbarten Spalten von Säulen verlaufen die Wortleitungen, die jeweils mit Gateelektroden verbunden sind. Zwischen den Wortleitungen und den Bitleitungen ist eine Isolationsstruktur vorgesehen. Die Wortleitungen sind darüber hinaus gegenüber den aktiven Transistorgebieten isoliert.

Die Säulen werden vorzugsweise durch zwei Ätzschritte hergestellt. Dabei werden zunächst erste Gräben geätzt, die im wesentlichen parallel verlaufen. Im zweiten Ätzschritt werden zweite Gräben geätzt, die die ersten Gräben kreuzen und ebenfalls im wesentlichen parallel verlaufen. Werden die ersten Gräben und die zweiten Gräben so dimensioniert, daß die Breite jedes Grabens gleich dem Abstand zwischen benachbarten Gräben ist und wird diese Breite entsprechend der in der jeweiligen Technologie kleinsten herstellbaren Strukturgröße F gewählt, so beträgt die Fläche für eine Speicherzelle $4F^2$. Das heißt, in einer 0,18 μm -Technologie benötigt jede Speicherzelle eine Fläche von 0,13 μm^2 .

Im folgenden wird die Erfindung anhand der Figuren und eines Ausführungsbeispiels näher erläutert.

Figur 1 zeigt einen Schnitt durch ein Substrat nach der Bildung von ersten Gräben und Bitleitungen.

Figur 2 zeigt einen Schnitt parallel zum Verlauf der Bitleitungen durch das Substrat nach der Bildung zweiter Gräben.

Figur 3 zeigt einen Schnitt parallel zu einer Bitleitung zwischen benachbarten Bitleitungen durch das Substrat nach der Ätzung von Öffnungen für vertikale MOS-Transistoren.

Figur 4 zeigt einen Schnitt senkrecht zu den Bitleitungen durch das Substrat nach der Öffnung der Löcher zur Bildung der vertikalen MOS-Transistoren.

Figur 5 zeigt einen Schnitt senkrecht zu den Bitleitungen durch das Substrat nach der Bildung von Gateoxid, Gateelektrode, Kondensatordielektrikum und Kondensatorplatte.

Figur 6 zeigt einen Schnitt senkrecht zu den Bitleitungen, parallel zu den Wortleitungen durch eine Wortleitung durch das Substrat nach der Bildung von Gateoxid, Gateelektrode, Wortleitungen, Kondensatordielektrikum und Kondensatorplatte.

Figur 7 zeigt eine schematische Aufsicht auf ein Substrat mit den ersten Gräben und den zweiten Gräben und den Maskenöffnungen zur Bildung der Löcher für die vertikalen MOS-Transistoren.

In einer Hauptfläche 1 eines Substrates 2 aus zum Beispiel monokristallinem Silizium, das mindestens im Bereich für eine DRAM-Zellenanordnung p-dotiert mit einer Dotierstoffkonzentration von zum Beispiel $5 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ ist, wird ganzflächig ein n⁺-dotiertes Gebiet 3 erzeugt. Das n⁺-dotierte Gebiet 3 wird zum Beispiel durch Ionenimplantation gebildet. Es weist eine Dotierstoffkonzentration von zum Beispiel $1 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ auf. Die Tiefe des n⁺-dotierten Gebietes beträgt zum Beispiel 0,5 μm .

Unter Verwendung einer Grabenmaske aus zum Beispiel SiO_2 und Photolack (nicht dargestellt) werden in der Hauptfläche 1 erste Gräben 4 geätzt. Die ersten Gräben 4 verlaufen im wesentlichen parallel. Sie weisen eine Tiefe von zum Beispiel 0,8 μm auf. Die Weite der ersten Gräben 4 beträgt zum Beispiel $F = 180 \text{ nm}$, der Abstand zwischen benachbarten Gräben 4 beträgt zum Beispiel $F = 180 \text{ nm}$. Die ersten Gräben 4 erstrecken sich parallel zur Hauptfläche 1 über das gesamte Zellenfeld und weisen eine Länge von zum Beispiel 100 μm auf. Die Tiefe der ersten Gräben 4 muß mindestens so hoch sein, daß die ersten Gräben 4 durch das n⁺-dotierte Gebiet 3 hindurchreichen (siehe Figur 1).

Durch Ionenimplantation werden am Boden der ersten Gräben 4 n⁺-dotierte Bitleitungen 5 gebildet. Die Bitleitungen 5 weisen eine Dotierstoffkonzentration von zum Beispiel mindestens 10^{20} cm^{-3} und eine Tiefe von zum Beispiel 0,2 μm auf.

Die ersten Gräben 4 werden anschließend mit einer ersten Isolationsstruktur 6 aus zum Beispiel SiO_2 aufgefüllt. Die erste Isolationsstruktur 6 wird zum Beispiel durch konforme Abscheidung einer SiO_2 -Schicht und anschließende Planarisierung gebildet.

Anschließend werden unter Verwendung einer zweiten Grabenmaske zweite Gräben 7 geätzt, die die ersten Gräben 4 im wesentlichen im rechten Winkel

kreuzen. Die zweiten Gräben 7 werden in derselben Tiefe wie die ersten Gräben 4 geätzt. Es ist wesentlich, daß die Oberfläche der Bitleitungen in den zweiten Gräben 7 freigelegt wird. Anschließend werden die zweiten Gräben 7 mit zweiten Isolationsstrukturen 8 aufgefüllt. Die zweiten Isolationsstrukturen 8 reichen in etwa bis zu der Höhe der n^+ -dotierten Gebiete 3. Die zweiten Isolationsstrukturen 8 werden zum Beispiel aus SiO_2 durch konforme Abscheidung einer SiO_2 -Schicht und anschließendes Rückätzen gebildet (siehe Figur 2, in der ein Schnitt senkrecht zu dem in Figur 1 dargestellten Schnitt, parallel zu einer Bitleitung 5, zwischen zwei benachbarten Bitleitungen 5 darstellt).

Je zwei Paare benachbarter erster Gräben 4 sowie zweiter Gräben 7 definieren eine Säule aus Silizium, die im Bereich der Hauptfläche 1 das n^+ -dotierte Gebiet 3 und darunter Substratmaterial 2, das p-dotiert ist, aufweist.

Es wird eine Maske 9 aus zum Beispiel SiO_2 erzeugt, die Maskenöffnungen 10 aufweist. Die Maskenöffnungen 10 weisen einen parallel zur Hauptfläche 1 im wesentlichen quadratischen Querschnitt auf und sind rasterförmig angeordnet. Durch die Maskenöffnungen 10 wird die Anordnung von vertikalen MOS-Transistoren definiert. Die Maskenöffnungen 10 sind so angeordnet, daß sie jeweils eine Ecke einer der Säulen überlappen. Der quadratische Querschnitt der Maskenöffnungen 10 weist eine Seitenlänge auf, die gleich der Breite der ersten Gräben 4 sowie der zweiten Gräben 7 ist. Die Mitte der Maskenöffnungen 10 ist jeweils um eine halbe Seitenlänge in Bezug auf die Mitten der angrenzenden ersten Gräben 4 und zweiten Gräben 7 versetzt angeordnet. Die Breiten und Abstände der Gräben 4, 7 betragen jeweils eine minimal herstellbare Strukturgröße F, die Seitenlänge der Maskenöffnungen 10 beträgt ebenfalls eine minimal herstellbare Strukturgröße F. Die Mitte der Maskenöffnungen 10 ist bezüglich der Mitten der Gräben 4, 7 jeweils um $1/2 F$ versetzt. Dabei wird ausgenutzt, daß die Justiergenauigkeit feiner als die kleinste herstellbare Strukturgröße ist. In einer 1 Gbit-Technologie beträgt die kleinste herstellbare Strukturgröße F gleich 180 nm, eine Justierung ist mit einer Genauigkeit von ca. $1/3 F$ möglich.

In einem anisotropen Ätzprozeß, der SiO_2 selektiv zu Silizium angreift, zum Beispiel mit reaktivem Ionenätzen, werden Löcher 11 geätzt, die von der Hauptfläche 1 bis auf die Höhe der Bitleitungen 5 reichen (siehe Figur 3 und Figur 4). Die Löcher 11 weisen einen hakenförmigen Querschnitt auf, wobei sich der Haken aus drei kleinen Quadraten zusammensetzen läßt. Das fehlende, vierte kleine Quadrat entsteht durch die Säule aus Silizium, die bei dem anisotropen Ätzprozeß nicht angegriffen wird. Die Flanken der Säule werden in dem Loch 11 freigelegt.

Nach Entfernen der Maske 9 wird zur Bildung eines Gateoxids 12 eine thermische Oxidation bei zum Beispiel 800°C durchgeführt. Dabei entsteht an allen freiliegenden Siliziumoberflächen SiO_2 . Anschließend werden Gateelektroden 13 und Wortleitungen 14 aus

dotiertem Polysilizium erzeugt. Dazu wird zum Beispiel durch in situ dotierte Abscheidung eine Polysiliziumschicht erzeugt, die so dick ist, wie die Löcher 11 und die zweiten Gräben 7 oberhalb der zweiten Isolationsstruktur 8 in der Breite auffüllt. Anschließend wird die dotierte Polysiliziumschicht zum Beispiel durch reaktives Ionenätzen zurückgeätzt, bis die Höhe der Wortleitung 14 unterhalb der Hauptfläche 1 erreicht ist. Die Abmessung der Wortleitungen 14 wird über die Ätzdauer eingestellt. Die Strukturierung der Wortleitungen 14 erfolgt selbstjustiert.

Durch Abscheiden und Rückätzen einer weiteren SiO_2 -Schicht werden oberhalb der Wortleitungen dritte Isolationsstrukturen 15 gebildet. Die Höhe der dritten Isolationsstrukturen 15 ist geringer als die Hauptfläche 1, so daß an den Flanken des n^+ -dotierten Gebietes 3 der Säulen jeweils Stufen auftreten (siehe Figur 5 und Figur 6). Die Höhe dieser Stufen beträgt zum Beispiel 0,2 bis 0,5 μm .

Anschließend wird ein Kondensatordielektrikum 16 aufgebracht. Das Kondensatordielektrikum weist eine Dicke von zum Beispiel 50 nm auf. Dazu wird zum Beispiel eine durchgehende ferroelektrische oder paraelektrische Schicht mit einer relativen Dielektrizitätskonstante ϵ_r im Bereich zwischen 500 und 1000 durch Sputtern, CVD-Abscheidung oder in einem Sol-Gel-Verfahren aufgebracht. Vorzugsweise umfaßt das Kondensatordielektrikum mindestens einen der Stoffe Barium-Strontium-Titanat, Strontium-Titanat oder Bleizirkontitanat. Das Kondensatordielektrikum 16 ist im Bereich der n^+ -dotierten Gebiete 3 auf der Siliziumoberfläche angeordnet, die beim Rückätzen der dritten Isolationsstrukturen 15 freigelegt wurde. In Fällen, in denen eine Reaktion zwischen dem Material des Kondensatordielektrikums 16 und dem Silizium oder eine Diffusion des Materials des Kondensatordielektrikums 16 in das Silizium oder eine sonstige Beeinträchtigung des Siliziums durch das Material des Kondensatordielektrikums 16 befürchtet werden muß, wird mindestens die freiliegende Oberfläche des n^+ -dotierten Gebietes 3 mit einer Zwischenschicht, zum Beispiel aus TiN, RuO_2 , Pt, W, abgedeckt.

Weist das Material des Kondensatordielektrikums 16 Leckströme in einem Ausmaß auf, das für einen Speicherkondensator nicht hinnehmbar ist, so wird das Kondensatordielektrikum 16 strukturiert. Dabei wird das Kondensatordielektrikum 16 jeweils oberhalb der dritten Isolationsstruktur 15 bzw. der ersten Isolationsstruktur 6 unterbrochen.

Auf das Kondensatordielektrikum 16 wird eine durchgehende Kondensatorplatte 17 aus zum Beispiel PolySi, TiN, Pt, W, RuO_2 aufgebracht. Die Kondensatorplatte 17 überdeckt mindestens den Bereich der ersten und zweiten Gräben.

Figur 7 zeigt eine schematische Aufsicht auf das Substrat 2 mit den ersten Gräben 4 und den zweiten Gräben 7. Ferner ist in Figur 7 als strichpunktierte Umrahmung die Lage der Maskenöffnungen 10 angegeben. Zum besseren Verständnis sind ferner durch

strichpunktierter Linien mit der Bezeichnung I, II, III, IV, V, VI die Schnitte angedeutet, die in den Figuren 1, 2, 3, 4, 5, 6 dargestellt sind.

Da die ersten Gräben 4 parallel verlaufen und gleiche Breite und gleichen Abstand, zum Beispiel eine minimale Strukturgröße $F = 180 \text{ nm}$ aufweisen und die zweiten Gräben 7 ebenfalls gleiche Breite und Abstände, zum Beispiel eine minimale Strukturgröße $F = 180 \text{ nm}$ aufweisen, beträgt der Platzbedarf pro Speicherzelle $(2 \times \text{Grabenbreite})^2$, zum Beispiel $4 F^2 = 0,13 \mu\text{m}^2$.

Abgesehen von der möglichen Strukturierung des Kondensatordielektrikums werden zur Herstellung der erfindungsgemäßen DRAM-Zellenanordnung drei zu justierende Masken benötigt. Dabei sind die beiden Masken, die zur Ätzung der ersten Gräben 4 sowie der zweiten Gräben 7 eingesetzt werden, unkritisch bezüglich der Justierung. Lediglich die Maske 9, mit der die Löcher 11 geätzt werden, muß genau justiert werden.

Bei Verwendung eines Materials für das Kondensatordielektrikum 16, das eine ausreichend hohe relative Dielektrizitätskonstante ϵ_r aufweist, kann die dritte Isolationsstruktur 15 so gebildet werden, die in der Höhe mit der Hauptfläche 1 abschließt. In der erfindungsgemäßen DRAM-Zellenanordnung bilden n^+ -dotiertes Gebiet 3, Bitleitung 5 sowie dazwischenliegendes Substrat 2 mit dem Gateoxid 12 und der Gateelektrode 13 jeweils einen vertikalen MOS-Transistor. Das n^+ -dotierte Gebiet 3, das Kondensatordielektrikum 16 und die Kondensatorplatte 17 bilden den Speicherkondensator. Das n^+ -dotierte Gebiet 3 wird gleichzeitig als Source/Drain-Gebiet des vertikalen MOS-Transistors und als Speicherknoten des Speicherkondensators verwendet. Dadurch wird ein Platzgewinn erzielt. Darüber hinaus sind Source/Drain-Gebiete des vertikalen MOS-Transistors und Speicherknoten des Speicherkondensators herstellungsgemäß miteinander elektrisch verbunden, so daß die im Stand der Technik zur Verbindung der Polysiliziumstruktur mit dem Substrat bei Stapelkondensatoren erforderliche, kritische Kontaktlochlätzung entfällt.

Bezugszeichenliste

1	Hauptfläche	
2	Substrat	
3	n^+ -dotiertes Gebiet	
4	erste Gräben	
5	Bitleitungen	
6	erste Isolationsstruktur	
7	zweite Gräben	
8	zweite Isolationsstruktur	
9	Maske	
10	Maskenöffnungen	
11	Loch	
12	Gateoxid	
13	Gateelektrode	
14	Wortleitungen	
15	dritte Isolationsstrukturen	

16	Kondensatordielektrikum
17	Kondensatorplatte

Patentansprüche

1. DRAM-Zellenanordnung, mit Speicherzellen, die jeweils einen Auslesetransistor und einen Speicherkondensator umfassen,

- wobei die Auslesetransistoren als in einem Halbleitersubstrat (2) integrierte, vertikale MOS-Transistoren, deren eines Source/Drain-Gebiet (3) jeweils an einer Hauptfläche (1) des Halbleitersubstrates (2) und deren anderes Source/Drain-Gebiet (5) jeweils an eine im Halbleitersubstrat (2) vergrabene Bitleitung (5) angrenzt und deren Gateelektrode (13) mit einer im Halbleitersubstrat (2) vergrabenen, die Bitleitungen (5) kreuzenden Wortleitung (14) in Verbindung steht, ausgebildet sind,
- wobei die Speicherkondensatoren jeweils aus einem der an die Hauptfläche (1) angrenzenden Source/Drain-Gebiete (3) als Speicherknoten, einem darüber angeordneten Kondensatordielektrikum (16) und einer Kondensatorplatte (17) aufgebaut sind.

2. DRAM-Zellenanordnung nach Anspruch 1,

- bei der das Halbleitersubstrat (2) mindestens im Bereich der DRAM-Zellenanordnung von einem ersten Leitfähigkeitstyp dotiert ist,
- bei der das Halbleitersubstrat (2) in Reihen und Spalten angeordnete Säulen umfaßt, die an eine Hauptfläche (1) des Halbleitersubstrats (2) angrenzen,
- bei der jede Säule ein von einem zweiten, dem ersten entgegengesetzten Leitfähigkeitstyp dotiertes Gebiet (3) und ein vom ersten Leitfähigkeitstyp dotiertes Gebiet (2) aufweist, wobei das vom zweiten Leitfähigkeitstyp dotierte Gebiet (3) jeweils an die Hauptfläche (1) und im Bereich der Hauptfläche (1) an die Flanken der jeweiligen Säule angrenzt und wobei das vom ersten Leitfähigkeitstyp dotierte Gebiet (2) unterhalb des vom zweiten Leitfähigkeitstyp dotierten Gebietes (3) angeordnet ist, an die Flanken der Säule angrenzt und mit dem vom ersten Leitfähigkeitstyp dotierten Bereich des Halbleitersubstrats (2) in Verbindung steht,
- bei der die vergrabenen Bitleitungen (5) im wesentlichen parallel verlaufen und jeweils zwischen benachbarten Reihen der Säulen angeordnet sind,

- bei der die vergrabenen Wortleitungen (14) im wesentlichen parallel verlaufen, die Bitleitungen (5) kreuzen und jeweils zwischen benachbarten Spalten der Säulen angeordnet sind, 5
 - bei der jeweils entlang mindestens einer Flanke der Säulen ein Gateoxid (12) und eine der Gateelektroden (13) vorgesehen sind, die die jeweilige Flanke teilweise bedecken, so daß der zur Hauptfläche vertikale MOS-Transistor gebildet wird, 10
 - bei der die Gateelektroden (13) zu entlang einer der Spalten angeordneten Säulen jeweils mit einer der Wortleitungen (14) elektrisch verbunden sind, 15
 - bei der oberhalb der Säulen das Kondensatordielektrikum angeordnet ist, 20
 - bei der oberhalb des Kondensatordielektrikums (16) die durchgehende Kondensatorplatte (17) angeordnet ist, 20
 - bei der das vom zweiten Leitfähigkeitstyp dotierte Gebiet (3) in den Säulen jeweils gleichzeitig als Speicherknoten und als Source/Drain-Gebiet eines der vertikalen MOS-Transistoren wirkt, 25
 - bei der Isolationsstrukturen vorgesehen sind, durch die die Wortleitungen (14) und die Gateelektroden (13) gegenüber den Bitleitungen (5), den Siliziumsäulen (2, 3) und der Kondensatorplatte (17) isoliert sind. 30
3. DRAM-Zellenanordnung nach Anspruch 1 oder 2, bei der das Kondensatordielektrikum (16) aus einem Material mit einer relativen Dielektrizitätskonstante ϵ_r zwischen 100 und 1000 gebildet ist. 40
4. DRAM-Zellenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei der das Kondensatordielektrikum (16) als ganzflächige Schicht ausgebildet ist. 45
5. DRAM-Zellenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei der die Isolationsstrukturen (6, 15) den Bereich zwischen benachbarten Siliziumsäulen nur teilweise auffüllen, so daß im Bereich der Hauptfläche (1) die Flanken der Siliziumsäulen teilweise mit Kondensatordielektrikum (16) bedeckt sind. 50
6. DRAM-Zellenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 55
- bei der die Breite der Bitleitungen (5) und der Wortleitungen (14) sowie der Abstand zwischen benachbarten Bitleitungen (5) und zwischen benachbarten Wortleitungen (14) jeweils im wesentlichen gleich ist,
 - bei der das Gateoxid (12) der vertikalen MOS-Transistoren jeweils zwei aneinander angrenzende Flanken einer Säule teilweise bedeckt.
7. DRAM-Zellenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
- bei der das Halbleitersubstrat (2) mindestens im Bereich der DRAM-Zellenanordnung monokristallines Silizium umfaßt,
 - bei der die Isolationsstrukturen SiO_2 umfassen,
 - bei der die Bitleitungen (5) als dotierte Gebiete im Halbleitersubstrat (2) ausgebildet sind,
 - bei der die Gateelektroden (13) und die Wortleitungen (14) dotiertes Polysilizium umfassen.
8. Verfahren zur Herstellung einer DRAM-Zellenanordnung,
- bei dem Speicherzellen mit jeweils einem Auslesetransistor und einem Speicherkondensator erzeugt werden,
 - bei dem in einem Halbleitersubstrat (2) vergrabene Bitleitungen (5) und vergrabene Wortleitungen (14) erzeugt werden,
 - bei dem die Auslesetransistoren als vertikale MOS-Transistoren in dem Halbleitersubstrat gebildet werden, deren eines Source/Drain-Gebiet (3) jeweils an einer Hauptfläche (1) des Halbleitersubstrats (2) angrenzt und deren anderes Source/Drain-Gebiet (5) jeweils an eine der vergrabenen Bitleitungen (5) angrenzt und deren Gateelektrode (13) mit einer der vergrabenen Wortleitungen (14) in Verbindung steht,
 - bei dem zur Bildung der Speicherkondensatoren oberhalb der an die Hauptfläche (1) angrenzenden Source/Drain-Gebiete (3) ein Kondensatordielektrikum (16) und eine Kondensatorplatte (17) aufgebracht werden, so daß das an die Hauptfläche (1) angrenzende Source/Drain-Gebiet (3) gleichzeitig als Speicherknoten wirkt.
9. Verfahren nach Anspruch 8, bei dem das Kondensatordielektrikum (16) aus einem Material mit einer relativen Dielektrizitätskonstante ϵ_r zwischen 100 und 1000 gebildet wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9,
bei dem das Kondensatordielektrikum (16) als
durchgehende Schicht gebildet wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10,

- bei dem in einem Halbleitersubstrat (2), das
mindestens in einem Bereich für die DRAM-
Zellenanordnung von einem ersten Leitfähig-
keitstyp dotiert ist, ein von einem zweiten, dem
ersten entgegengesetzten Leitfähigkeitstyp
dotiertes Gebiet (3) erzeugt wird, das an eine
Hauptfläche (1) des Halbleitersubstrats (2)
angrenzt,

- bei dem in dem Halbleitersubstrat (2) im
wesentlichen parallel verlaufende erste Gräben
(4) erzeugt werden,

- bei dem am Boden der ersten Gräben (4) Bitlei-
tungen (5) erzeugt werden,

- bei dem die ersten Gräben (4) mit einer ersten
Isolationsstruktur (6) aufgefüllt werden,

- bei dem zweite Gräben (7) erzeugt werden, die
die ersten Gräben (4) kreuzen und die minde-
stens bis auf die Oberfläche der Bitleitung (5)
reichen, wobei Säulen aus Halbleitermaterial
entstehen, die jeweils zwischen zwei benach-
barten ersten Gräben (4) und zwei benachbar-
ten zweiten Gräben (7) angeordnet sind,

- bei dem die zweiten Gräben mit einer zweiten
Isolationsstruktur (8) aufgefüllt werden, deren
Höhe geringer ist als die Tiefe der zweiten Grä-
ben (7),

- bei dem eine anisotrope Ätzung durchgeführt
wird, die die erste Isolationsstruktur (6) und die
zweite Isolationsstruktur (8) selektiv zu den
Säulen das Halbleitermaterial angreifen und
bei der Löcher (11) geätzt werden, die von der
Hauptfläche (1) bis auf die Höhe der Bitleitun-
gen (5) reichen und in denen jeweils minde-
stens eine Flanke der Säulen, die an einen der
zweiten Gräben (7) angrenzt, teilweise freige-
legt wird,

- bei dem an den freiliegenden Flanken der Sä-
ulen Gateoxide (12) erzeugt werden,

- bei dem in den Löchern Gateelektroden (13)
erzeugt werden, die die Löcher (11) jeweils
ausfüllen,

- bei dem in den zweiten Gräben (7) Wortleitun-
gen (14) erzeugt werden, die jeweils mit ent-
lang dem jeweiligen zweiten Gräben (7)

angeordneten Gateelektroden (13) elektrisch
verbunden sind,

- bei dem in den zweiten Gräben (7) eine dritte
Isolationsstruktur (15) erzeugt wird,

- bei dem ein Kondensatordielektrikum (16)
erzeugt wird, das mindestens die Oberfläche
der Säulen im Bereich der Hauptfläche (1)
bedeckt,

- bei dem eine Kondensatorplatte (17) erzeugt
wird, die mindestens die Säulen überdeckt.

12. Verfahren nach Anspruch 11,

- bei dem die ersten Isolationsstrukturen (6) und
die dritten Isolationsstrukturen (15) so gebildet
werden, daß sie in der Höhe mit den Säulen
abschließen,

- bei dem in einem Ätzprozeß selektiv zu den
Säulen die ersten Isolationsstrukturen (6) und
die dritten Isolationsstrukturen (15) rückgeätzt
werden, wobei an den Flanken der Säulen Stu-
fen entstehen, die von dem Kondensatordielek-
trikum (16) abgedeckt werden.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 oder 12,

bei dem die ersten Gräben (4) und die zweiten
Gräben (7) im wesentlichen in gleicher Breite
gebildet werden, wobei der Abstand benach-
barter Gräben (4, 7) im wesentlichen gleich der
Breite der Gräben ist,

- bei dem die Löcher (11) unter Verwendung
einer Maske (9) mit im wesentlichen quadrati-
schen Maskenöffnungen (10) geätzt werden,
wobei die Seitenlänge der quadratischen Mas-
kenöffnungen (10) im wesentlichen gleich der
Breite der Gräben (4, 7) ist,

- bei dem die Mittelpunkte der quadratischen
Maskenöffnungen (10) gegenüber den Mitten
der ersten Gräben (4) sowie der zweiten Grä-
ben (7) um weniger als eine Breite der Gräben
(4, 7) versetzt angeordnet werden.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13,

- bei dem als Halbleitersubstrat (2) ein Substrat
verwendet wird, das mindestens im Bereich
der DRAM-Zellenanordnung monokristallines
Silizium umfaßt,

- bei dem die Isolationsstrukturen (6, 8, 15) aus
SiO₂ gebildet werden,

- bei dem die Bitleitungen und das vom zweiten Leitfähigkeitstyp dotierte Gebiet (3) durch Implantation gebildet werden,
- bei dem die Wortleitungen (14) und die Gate-
elektroden (13) aus dotiertem Polysilizium
gebildet werden.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

FIG 1

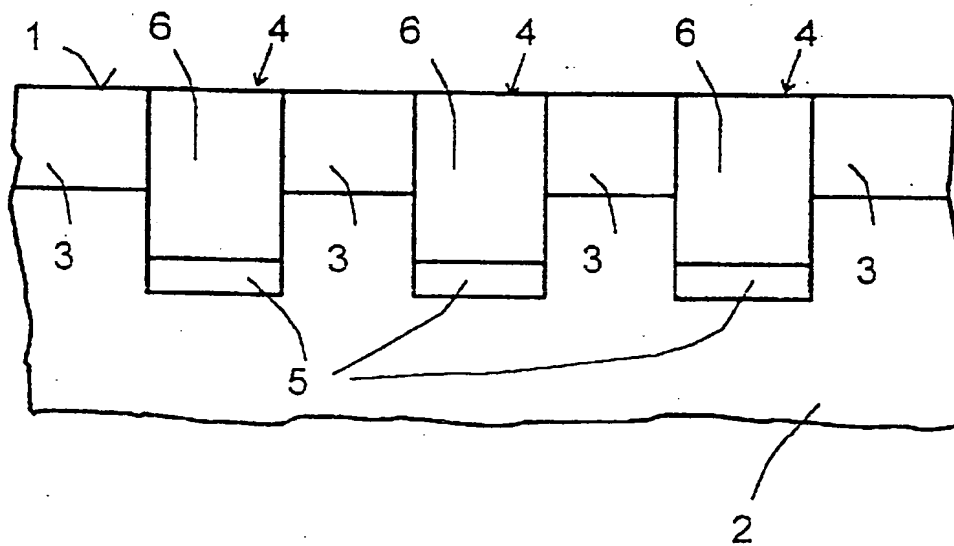


FIG 2

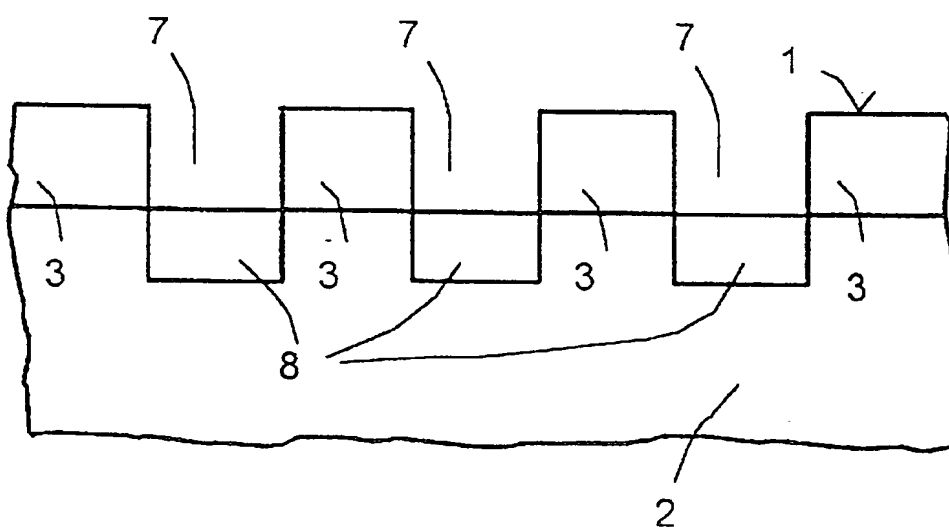


FIG 3

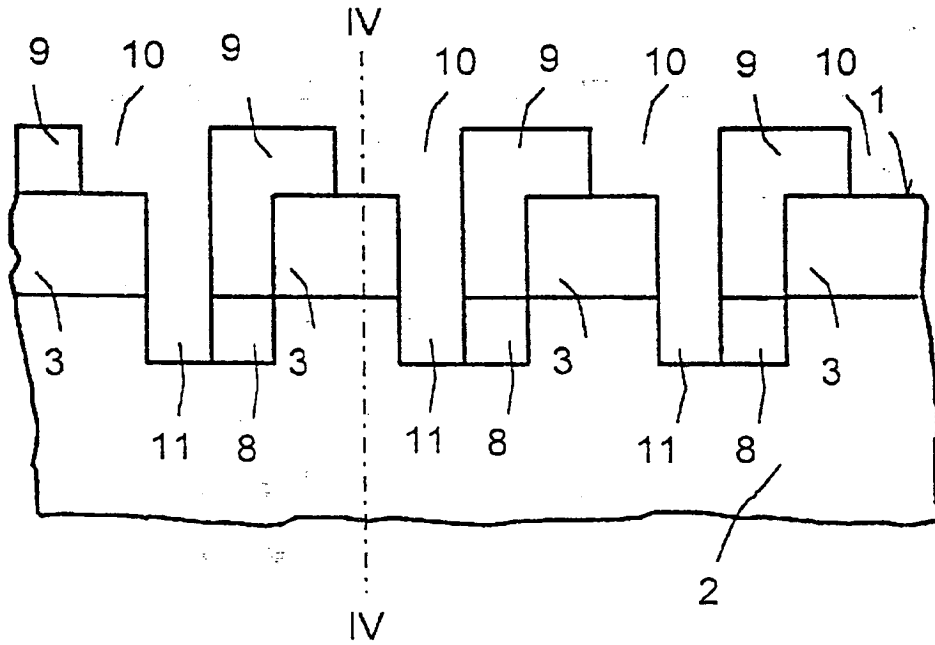


FIG 4

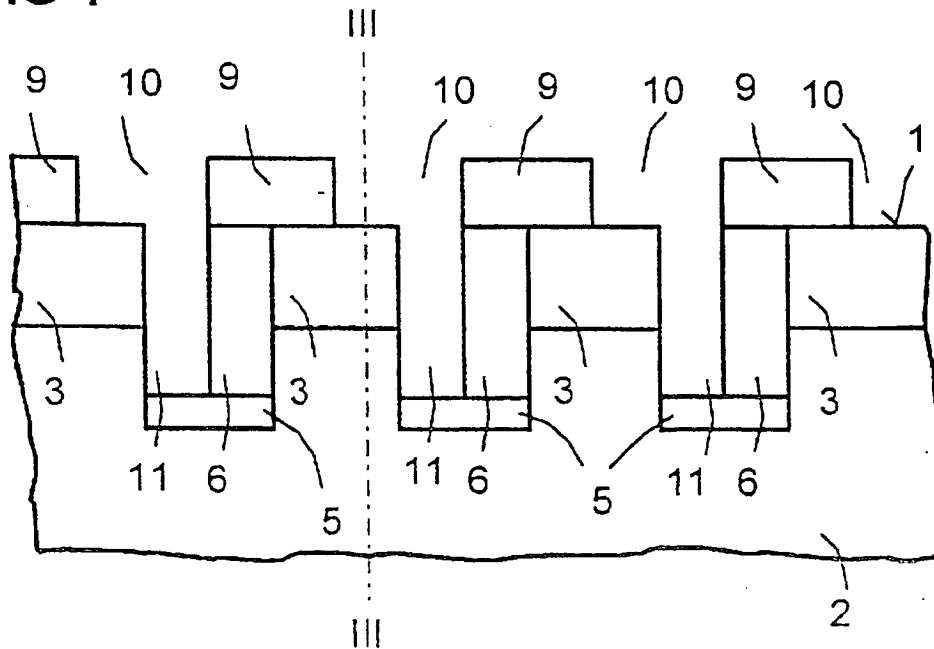


FIG 5

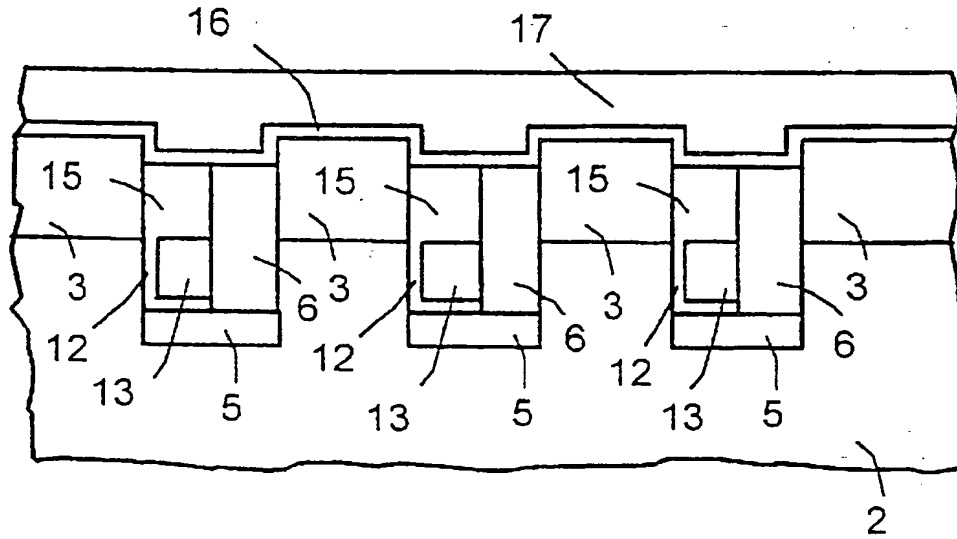


FIG 6

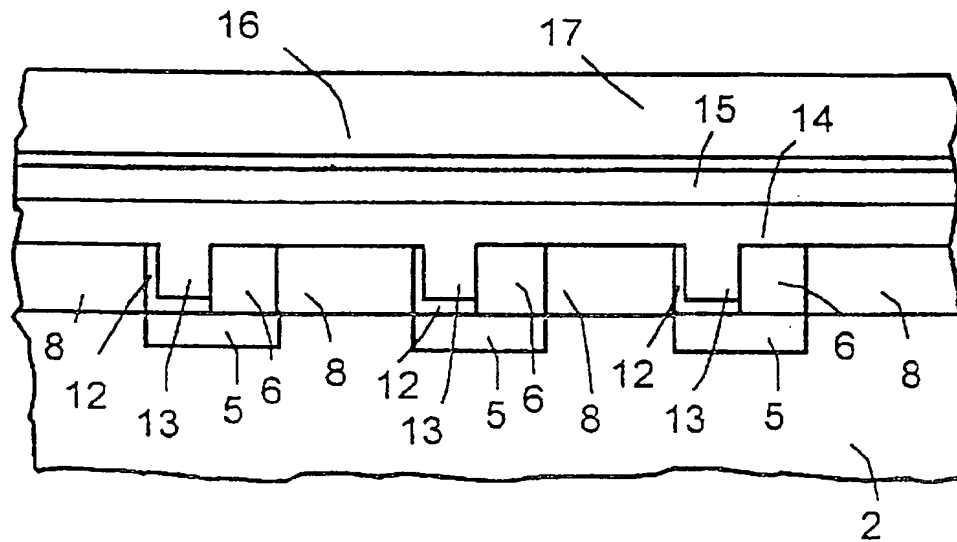
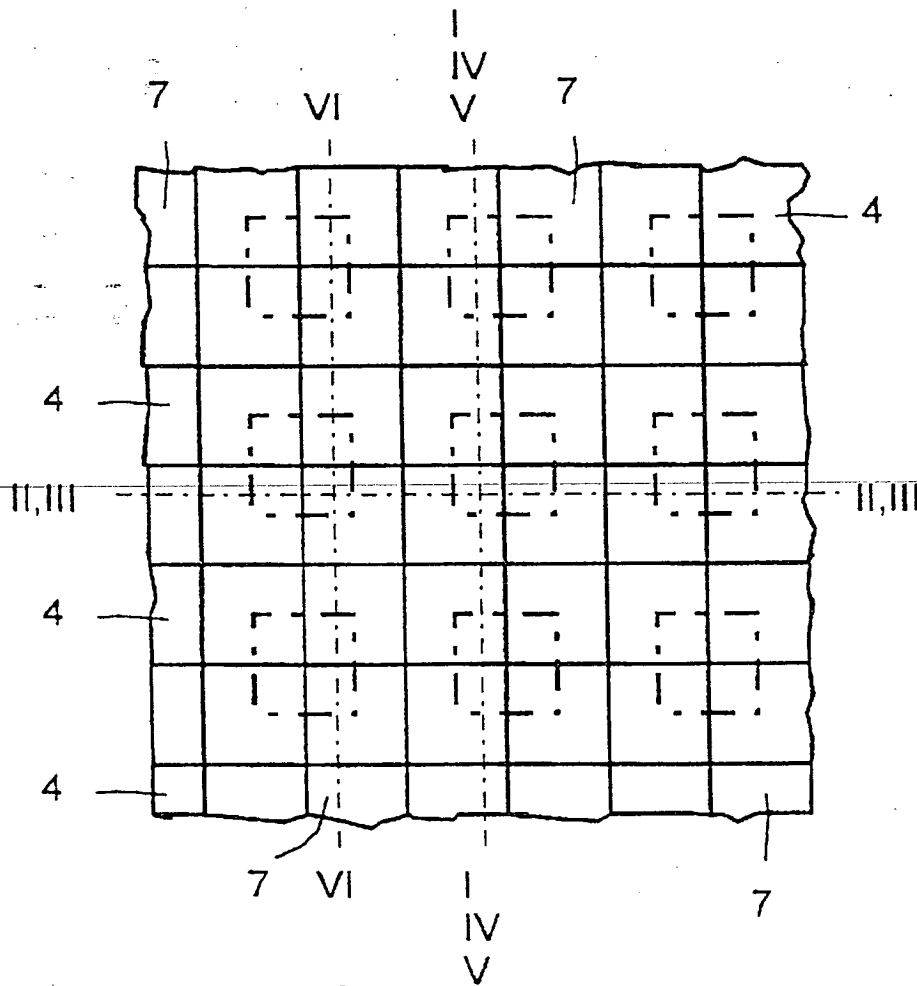


FIG 7





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 96 10 7434

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	US-A-4 974 060 (HITACHI LTD) * das ganze Dokument *	1-14	H01L27/108 H01L21/8242
A	EP-A-0 175 433 (KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA) * Zusammenfassung; Abbildungen *	1-14	
A	US-A-5 376 575 (HYUNDAI ELECTRONICS INDUSTRIES) * Zusammenfassung; Abbildungen *	1-14	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 17, no. 401 (E-1404), 27.Juli 1993 & JP-A-05 075059 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP), 26.März 1993, * Zusammenfassung *	1-14	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 14, no. 156 (E-908), 26.März 1990 & JP-A-02 014563 (MATSUSHITA ELECTRON CORP), 18.Januar 1990, * Zusammenfassung *	1-14	
A	INTERNATIONAL ELECTRON DEVICES MEETING 1991, Bd. 17, Nr. 2.1, 8. - 11.Dezember 1991, WASHINGTON, DC, USA, Seiten 469-472, XP000342180 T. OZAKI ET AL.: "A Surrounding Isolation-Merged Plate Electrode (SIMPLE) Cell with checkered layout for 256Mbit DRAM and beyond" * Zusammenfassung; Abbildungen *	1-14	H01L
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 16, no. 59 (E-1166), 14.Februar 1992 & JP-A-03 256358 (HITACHI LTD), 15.November 1991, * Zusammenfassung *	3,4,9,10	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschließdatum der Recherche 8. August 1996	Prüfer Sinemus, M
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: schriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPO FORM 1503 (01/91) (P0100)

DOCKET NO: P2002,0635

SERIAL NO: 10/631,355

APPLICANT: Fuhrmann et al.

LERNER AND GREENBERG P.A.

P.O. BOX 2480

HOLLYWOOD, FLORIDA 33022

TEL. (954) 925-1100